

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 15 日 (15.09.2005)

PCT

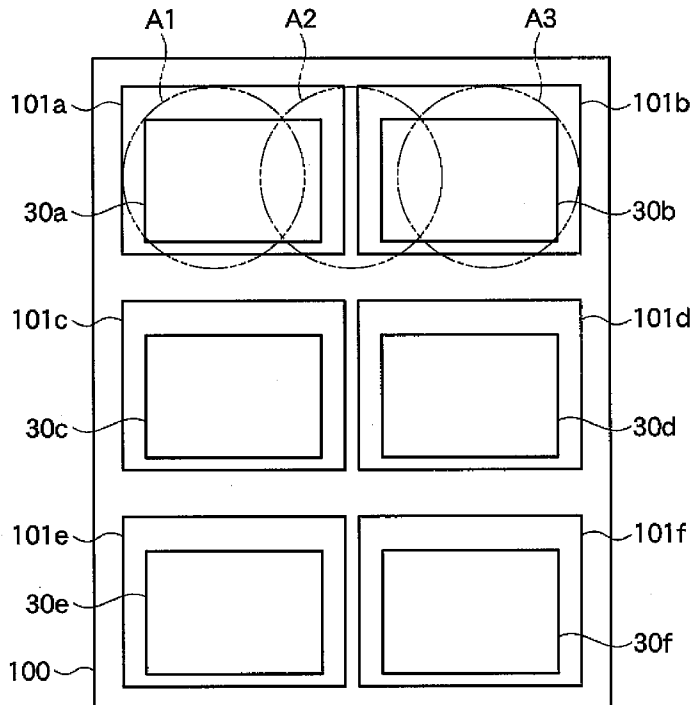
(10) 国際公開番号
WO 2005/085938 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G02F 1/13, 1/1368, G09F 9/30, G01R 31/28
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002815
(22) 国際出願日: 2005 年 2 月 22 日 (22.02.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願2004-062654 2004 年 3 月 5 日 (05.03.2004) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 (TOSHIBA)
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 富田 暁 (TOMITA, Satoru) [JP/JP].
(74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 7 番 2 号 鈴榮特許総合事務所内 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

[続葉有]

(54) Title: BOARD INSPECTING METHOD, ARRAY BOARD INSPECTING METHOD AND ARRAY BOARD INSPECTING EQUIPMENT

(54) 発明の名称: 基板の検査方法、アレイ基板の検査方法、及びアレイ基板の検査装置



(57) Abstract: In each of a plurality of regions on a mother board (100), array board parts (101a to 101f) which include pixel regions (30a to 30f) are formed. In the pixel region in each array board part, a plurality of scanning lines and a plurality of signal lines are formed to cross, and a pixel part is formed in the vicinity of respective crossing parts. In a method for inspecting the pixel part by storing the whole mother board in a vacuum chamber and inspecting the pixel part with an electronic beam tester, an area to be irradiated with beams by electronic beam scanning of an electronic beam scanner is set to span the parts of a plurality of the array board parts (101a to 101f) or to cover the entire array board parts at the same time, and inspection information of the pixel part of each array board part within the irradiation area is obtained.

(57) 要約: マザー基板 (100) 上の複数の領域にはそれぞれ画素領域 (30a ないし 30f) を含むアレイ基板部 (101a ないし 101f) が形成されている。各アレイ基板部内の画素領域では、複数の走査線と複数の信号線とが交差して形成され、これら複数の

[続葉有]



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

と複数の信号線との交差部近傍にそれぞれ画素部が形成されている。マザー基板全体を真空チャンバーに収容し、電子ビームテストを用いて画素部の検査を行う検査方法において、電子ビーム走査器による電子ビーム走査でビーム照射される照射範囲が、複数のアレイ基板部（101aないし101f）の一部を跨いだ又は全部を同時にカバーした状態に設定し、その照射範囲に属する各アレイ基板部の画素部の検査情報を取得する。